

в течение одного цикла изменений. Эти результаты показывают, что замена металлического катода на катод из перовскита наиболее существенно оказывается на энергии излучения после  $10^5$  включений.

Влияние материала катода на энергию излучения может быть вызвано не только более высокой устойчивостью разряда в этом случае, но и проявлением каталитических свойств перовскита вследствие нагрева [8]. Неожиданно быстрое снижение энергии излучения в этих экспериментах по сравнению с данными, полученными ранее [6], по-видимому, может быть связано с неоптимальной добротностью резонатора и другими условиями возбуждения объемного разряда.

Таким образом, использование электродов с высокой эмиссионной способностью для возбуждения объемных разрядов высокого давления в импульсно-периодическом  $\text{CO}_2$  лазере приводит к повышению устойчивости разряда, увеличению предельных энерговкладов и удельного энергосъема излучения, расширению диапазона частот, в которых разряд имеет объемный характер, и уменьшению спада энергии излучения лазера в процессе работы.

В заключение авторы благодарят С. И. Шкуратова за предоставленные данные по работе выхода перовскита типа  $\text{La}_{0.3}\text{Sr}_{0.7}\text{CoO}_3$ .

### Список литературы

- [1] Визирь В. А., Осипов В. В., Тельнов В. А., Хамидулин Г. М. // Кvantовая электроника. 1988. Т. 15. № 6. С. 1256.
- [2] Бычков Ю. И., Осипов В. В., Тельнов В. А., Хамидулин Г. М. // Изв. вузов. Физика. 1986. Т. 8. № 4. С. 89.
- [3] Бычков Ю. И., Осипов В. В., Савин В. В. // ЖТФ. 1976. Т. 46. Вып. 7. С. 1444.
- [4] Бычков Ю. И., Осипов В. В., Савин В. В. // Газовые лазеры. Новосибирск: Наука, 1980. С. 252–271.
- [5] Липатов Н. И., Пашинин П. П., Петров А. Н. и др. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. Вып. 19. С. 1209.
- [6] Козырев А. В., Королев Ю. Д., Месяц Г. А. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 1. С. 58.
- [7] Осипов В. В., Тельнов В. А., Хамидулин Г. М. // ПТЭ. 1988. № 1. С. 181.

Институт электрофизики АН СССР  
Уральское отделение  
Свердловск

Поступило в Редакцию  
14 ноября 1988 г.

## ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КРИСТАЛЛОВ НА ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$ И $\text{LiTaO}_3 : \text{Ti}$

B. B. Атучин, K. K. Зилинг

При получении оптических волноводов на ниобате и танталате лития с помощью диффузии титана профиль приращения обыкновенного  $\Delta n_0$  и необыкновенного  $\Delta n_e$  показателей преломления (ПП), а следовательно, модовый состав, эффективные ПП  $N_m$  и распределение электромагнитных полей мод наряду с технологическими параметрами определяются величиной коэффициента диффузии  $D$  при данной температуре и коэффициентами  $A_e$  и  $A_0$ , связанными мольной долей диффузанта с  $\Delta n_e$  и  $\Delta n_0$ .

При попытках предсказания условий синтеза волноводов с заранее заданными свойствами обычно принимается, что  $D$  и  $A$  — константы. Однако в работе [1] обнаружено заметное увеличение  $D$  при уменьшении мольной доли лития  $z$  в кристаллах ниобата лития, что связано, по-видимому, с увеличением концентраций катионных вакансий [2]. Учитывая, что кристаллическая структура  $\text{LiNbO}_3$  и  $\text{LiTaO}_3$  одинакова, можно ожидать аналогичного эффекта и в  $\text{LiTaO}_3$ . Кроме того, различия в оцененных по результатам работ [3–6] значениях  $A$  столь велики, что их трудно связать с погрешностями эксперимента. Это заставляет предполагать наличие физического механизма изменения  $A$ .

Целью настоящей работы является исследование зависимости указанных параметров от стехиометрии исходных кристаллов ниобата и танталата лития.

Эксперимент проведен на подложках  $\text{LiNbO}_3$  Z-реза и  $\text{LiTaO}_3$  Y-реза различного состава. Волноводы получены диффузией титана из пленки толщиной 780 Å на воздухе. Для  $\text{LiNbO}_3$  температура и время  $t$  диффузии составляли соответственно 980 °C и 8 ч, для  $\text{LiTaO}_3$  1260 °C и 10 ч. Для каждого материала операции по изготовлению структур проводились одновременно на всех подложках. Двулучепреломление подложек  $\Delta n^*$  и набор  $N_m$  волноводов определены в условиях призменного ввода света на длине волн  $\lambda=0.63 \text{ мкм}$ . По значениям  $\Delta n^*$  определен химический состав подложек, а по набору  $N_m$  с помощью обратного WKB-метода [7] восстановлены профили  $\Delta n_0$  и  $\Delta n_e$ .

Известно [8], что для системы  $\text{LiTaO}_3 : \text{Ti}$  величины  $\Delta n$  пропорциональны мольной доле титана по отношению к tantalу у

$$\Delta n_e = A_e y, \quad \Delta n_0 = A_0 y. \quad (1)$$

Для системы  $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$  выполняется первое из этих соотношений, а для  $\Delta n_0$  пропорциональность имеет место при  $y \geq 0.7\%$  [3]. На основании (1) значения  $D$  определены по форме профилей  $\Delta n$ . Для  $\text{LiNbO}_3$  использованы только профили  $\Delta n_e$ . Результаты представлены на рис. 1, a. Видно, что для обоих материалов  $D$  растет при уменьшении  $z$ . При этом качественно одинаковое поведение функций  $D(z)$  связано, по-видимому, с одной и той же зависимостью концентрации катионных вакансий от  $z$  для  $\text{LiNbO}_3$  и  $\text{LiTaO}_3$  [9]. Видно также, что полученные данные для ниобата лития практически совпадают с результатами работы [1].

Величины  $A_e$  и  $A_0$  для  $\text{LiTaO}_3$  и  $A_e$  для  $\text{LiNbO}_3$  определены из выражения

$$\int_0^\infty \Delta n(x) dx = A \mu,$$

где  $\mu$  — удельное число молей диффузанта в пленке,  $x$  — расстояние от поверхности волновода.

Коэффициенты  $A_0$  для ниобата лития найдены сопоставлением кривой  $\Delta n_0(x)$  с зависимостью  $y(x)$ , определенной по известным  $\Delta n_e(x)$  и  $A_e$ . Результаты приведены на рис. 1, б. Видно, что величины  $A_e$  в исследованном интервале меняются значительно, в то время как изменение  $A_0$  находится в пределах погрешности эксперимента. Полученные из эксперимента значения  $\Delta A/\Delta z$  с учетом погрешности измерений приведены в третьем столбце таблицы.

Проанализируем возможные причины полученных зависимостей  $A$  от  $z$ . Согласно [10], коэффициенты  $A$  могут быть представлены в виде

$$A_e = A_e^R + A_e^{P_s} + A_e^*, \quad A_0 = A_0^R + A_0^{P_s} + A_0^*,$$

где  $A_e^R$  отражает вклад изменения рефракции  $R$  кристалла при легировании,  $A_e^{P_s}$  — вклад за счет изменения спонтанной поляризации  $P_s$ ,  $A_e^*$  — вклад упругооптического эффекта.

Простейшие оценки показывают, что наблюдаемый эффект не определяется изменением  $A_e^R$ . Действительно, поскольку при добавлении  $\text{TiO}_2$  в  $\text{LiTaO}_3$  химическая формула образующегося твердого раствора имеет вид  $(\text{LiTa})_{1-y/(3-m)} \text{Ti}_y \text{O}_3$ , где  $m = 1.5$  [11], то из формулы Лоренц—Лорентца при  $\Delta n \ll n$  непосредственно следует

$$A_e^R = \frac{(n^2 + 2)^2}{6nV} (R^* - R/1.5). \quad (2)$$

Здесь  $V$  — мольный объем  $\text{LiTaO}_3$ ,  $R^*$  и  $R$  — мольные рефракции  $\text{TiO}_2$  и  $\text{LiTaO}_3$ . Используя приведенные в [12] данные о ПП, плотности  $\text{TiO}_2$  и соответствующие параметры  $\text{LiTaO}_3$ ,

Материал	Параметры	Эксперимент	Расчет
$\text{LiNbO}_3$	$\Delta A_e / \Delta z$	{ 16.6 ± 4.1 2.3 ± 3.3}	8 ± 2.2 2.6 ± 0.7
$\text{LiTaO}_3$	$\Delta A / \Delta z$	{ 9.2 ± 2.1 1.2 ± 2}	— —

имеем  $R^* \approx 13.0 \pm 0.2 \text{ см}^3$  и  $R = 17.64 \pm 0.03 \text{ см}^3$ . При отклонении от стехиометрии химическая формула tantalата лития, согласно [9], имеет вид  $\text{Li}_{1-F} \text{Ta}_{1+F/5} \text{O}_3$ , где  $F = (1 - 2z)/(1 - 0.8z)$ .

Легко видеть, что при изменении  $z$  рефракция кристалла изменится на величину  $\Delta R =$

$= F(3R_2/5 - R)$ , где вычисленная по данным работ [13, 14] молекулярная рефракция  $Ta_2O_5$ ,  $R_2 = 28.7 \pm 0.2 \text{ см}^3$ . Задавая изменение  $z$  в 1 % и подставляя  $R$  и  $R + \Delta R$  в (2), легко убедиться, что абсолютное изменение  $A^R$  является величиной  $\sim 1 \%$ , т. е. много меньше наблюдаемого экспериментального эффекта. Аналогичные оценки можно провести и для  $LiNbO_3$ .

Упругооптический эффект также не может быть основной причиной наблюдаемых изменений  $A$ , поскольку уменьшение параметров решетки  $LiNbO_3$  при легировании титаном практически одинаково для кристаллов стехиометрического [9] и конгруэнтного [15] составов. Кроме того, при наблюдаемых экспериментально изменениях параметров решетки абсолютный вклад упругооптического эффекта в  $A_e$  и  $A_0$  мал [16].

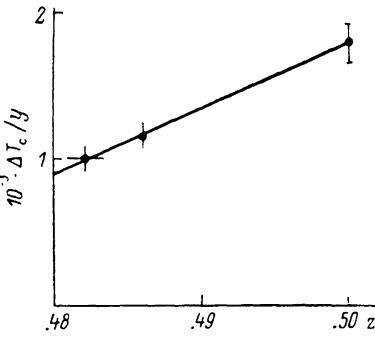
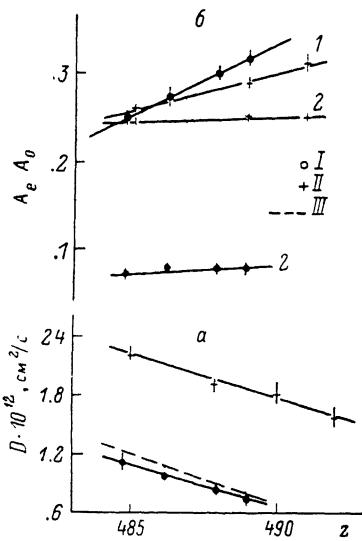


Рис. 2. Зависимость  $\Delta T_c/y$  от  $z$  для системы  $LiNbO_3 : Ti$ .

Рис. 1. Зависимости  $D$  (a),  $A_e$  и  $A_0$  (б) от  $z$ .

I —  $LiNbO_3 : Ti$ , II —  $LiTaO_3 : Ti$ , III —  $LiNbO_3 : Ti$  [1]; 1 —  $A_e$ , 2 —  $A_0$ .

Рассмотрим эффект увеличения ПП за счет уменьшения  $P_s$ . С учетом соотношения  $T_c = BP_s^2$  [17] и результатов [18] выражения для  $A^{P_s}$  можно записать в виде

$$A^{P_s} = -\frac{n_e^3}{2B} g_{ss} \frac{\Delta T_c}{y}, \quad A_0^{P_s} = -\frac{n_0^3}{2B} g_{13} \frac{\Delta T_c}{y}, \quad (3)$$

где  $T_c$  — температура Кюри;  $g_{ij}$  — квадратичные электрооптические коэффициенты;  $B$  — константа, величина которой приведена в [17].

Анализ литературных данных показал, что для  $LiNbO_3$  величина  $\Delta T_c/y$  заметно уменьшается при переходе от кристаллов с  $z=0.5$  [9] к кристаллам с  $z=0.486$  [15]. В настоящей работе емкостным методом дополнительно произведены измерения  $T_c$  на монокристаллах  $LiNbO_3$  с  $z=0.482 \pm 0.0014$  и содержанием титана от 0 до  $y=0.03$ . Результаты всех перечисленных измерений приведены на рис. 2, а выполненные на их основе оценки  $\Delta A/\Delta z$  помещены в 4-м столбце таблицы. Приведенная погрешность соответствует экспериментальным ошибкам определения  $T_c$  и не учитывает возможные неточности значений  $B$  и  $g_{ij}$ . Видно, что результаты эксперимента достаточно близки к расчетным оценкам, следовательно, наблюдаемая зависимость  $A$  ( $z$ ) является в основном следствием более медленного снижения  $T_c$  при легировании титаном бедных литием кристаллов. Для системы  $LiTaO_3 : Ti$  надежные количественные данные по измерению  $\Delta T_c/y$  при разных  $z$  отсутствуют, однако результаты работы [11] указывают на то, что эти изменения имеют качественно тот же характер.

Оценим теперь влияние совокупности обсуждаемых эффектов на оптические характеристики волноводных структур. В качестве примера рассмотрим планарный волновод с гауссовым распределением ПП. В рамках геометрической оптики дисперсионные характеристики записываются в универсальных координатах  $b_m$  и  $V$  [19], которые для данного случая можно представить в виде

$$b_m = \Delta N_m K_1 (t^{1/2}/\mu) (D^{1/2}/A), \quad V = K_2 (t^{1/2}\mu)^{1/2} (AD^{1/2})^{1/2}, \quad (4)$$

а условие отсечки записывается как

$$(m + 3/4)^2 = K_3 (t^{1/2}\mu) (AD^{1/2}). \quad (5)$$

Здесь  $\Delta N_m = N_m - n_b$ ,  $n_b$  — ПП подложки,  $K_i$  — численные коэффициенты. Примем, что для материала  $\text{LiNbO}_3$  поляризация соответствует необыкновенному лучу, а  $z$  меняется на 0.5 %. Используя приведенные на рис. 1 данные, легко показать, что в этом случае изменение ответственной за положение отсечки и значение  $V$  величины  $AD^1$ : составляет  $\sim 6\%$ , а изменение ответственной за значение  $\Delta N_m$  величины  $D^1/A \sim 70\%$ . Столь значительное изменение  $\Delta N_m$  вызовет гораздо большее изменение электромагнитных полей мод, длины эффективного взаимодействия и интегралов перекрытия оптических и электростатических полей, чем это можно было ожидать, исходя из анализа, проведенного в работе [2], учитывавшего только изменение  $D$ .

Таким образом, подтверждена для ниобата лития и обнаружена для tantalата лития зависимость коэффициента диффузии титана от состава кристаллов. Впервые обнаружен и интерпретирован эффект изменения коэффициентов  $A$  при изменении стехиометрии. На основе численных оценок показано, что совокупность указанных эффектов является, по-видимому, основной причиной плохой воспроизводимости оптических характеристик волноводов на ниобате и tantalате лития и приборов на их основе.

### Список литературы

- [1] Holmes R. J., Smyth D. M. // J. Appl. Phys. 1984. Vol. 55. N 10. P. 3531—3535.
- [2] Holmes R. J., Minford W. J. // Ferroelectrics. 1987. Vol. 75. N 1-2. P. 63—70.
- [3] Зилинг К. К., Покровский Л. Д., Шашкин В. В., Шипилова Д. П. // Автометрия. 1978. № 1. С. 103—108.
- [4] Minakata M., Saito S., Shibata M., Miyazawa S. // J. Appl. Phys. 1978. Vol. 49. N 9. P. 4677—4682.
- [5] Vollmer J., Nisius J. P., Hertel P., Krätzig E. // Appl. Phys. A. 1983. Vol. 32. N 3. P. 125—127.
- [6] Čtyroký J., Hofman M., Janta J., Schröfel J. // IEEE J. of Quant. Electronics. 1984. Vol. QE-20. N 4. P. 400—409.
- [7] Панькин В. Г., Пчелкин В. Ю., Шашкин В. В. // Квантовая электрон. 1977. Т. 4. № 7. С. 1497—1502.
- [8] Амучин В. В., Зилинг К. К., Шипилова Д. П. // Квантовая электрон. 1984. Т. 11. № 5. С. 994—998.
- [9] Elouadi B., Zriouil M. // J. Sol. State Chem. 1986. Vol. 64. N 1. P. 22—29.
- [10] Sugii K., Fukuma M., Iwasaki H. // J. Mat. Sci. 1978. Vol. 13. P. 523—533.
- [11] Elouadi B., Zriouil M. // Mat. Res. Bull. 1981. Vol. 16. N 19. P. 1099—1106.
- [12] Бацанов С. С. Структурная рефрактометрия. М.: Высшая школа, 1976. 304 с.
- [13] Oehrlein G. S., D'Heurle F. M., Reisman A. // J. Appl. Phys. 1984. Vol. 55. N 10. P. 3715—3725.
- [14] Terao N. // Jap. J. Appl. Phys. 1967. Vol. 6. N 1. P. 21—34.
- [15] Guenais B., Baudet M., Minier M., Le Cun M. // Mat. Res. Bull. 1981. Vol. 16. N 6. P. 643—653.
- [16] Зилинг К. К., Надолинный В. А., Шашкин В. В. // Неорган. материалы. 1980. Т. 16. № 4. С. 701—706.
- [17] Abrahams S. C., Kurtz S. K., Jamieson P. B. // Phys. Rev. 1968. Vol. 172. N 2. P. 551—553.
- [18] DiDomenico M., Wemple S. H. // J. Appl. Phys. 1969. Vol. 40. N 2. P. 720—734.
- [19] Hocker G. B., Burns W. K. // IEEE J. of Quant. Electronics. 1975. Vol. QE-11. N 6. P. 270—276.

Институт физики полупроводников СО АН СССР  
Новосибирск

Поступило в Редакцию  
15 декабря 1988 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ГЕТЕРОСТРУКТУРНОМ ФОТОДИОДЕ $n$ -ZnSe— $p$ -GaAs

Б. В. Жук, И. А. Жуков, А. А. Зленко, Е. А. Разов

В работе [1] нами было показано, что в переходе  $n$ -ZnSe— $p$ -GaAs вблизи гетерограницы существует слой компенсированного широкозонного материала с глубокими ловушками и глубокими отрицательно заряженными центрами. Следовательно, за счет встроенного отри-